**Сведения об официальном оппоненте**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО оппонента | Тагаченков Александр Михайлович |
| Учёная степень и наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация | Кандидат технических наук по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента на момент представления им отзыва | Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН) |
| Должность, занимаемая им в этой организации | Старший научный сотрудник |

**Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет**

1. С.Ю. Купреенко, Н.А. Орликовский, Э.И. Рау, А.М. Тагаченков, А.А. Татаринцев Определение толщин ультратонких поверхностных пленок в наноструктурах по энергетическим спектрам отраженных электронов // Журнал технической физики, Том 85, вып. 10. 2015. с. 101-104.

2. ПоповскихГ.Е., Зенова Е.В., Тагаченков А.М., Солдатов В.С. Сравнительное изучение подзатворных систем n- и p- канальных МДП транзисторов КМДП СБИС электрофизическими методами, Флуктуационные и деградационные процессы в полупроводниковых приборах (метрология, диагностика, технология, учебный процесс): Материалы докладов научно-методического семинара (Москва 27-28 11. 2014 г.) М: МНТОРЭС им. А.С. Попова, НИУ «МЭИ». 2015.- 171с., с. 123-129.

3. Гостев А.В., Евстафьева Е.Н., Рау Э.И., Тагаченков А.М. Характеристики зарядки диэлектрических пленок в зависимости от толщины при электронном облучении // Известия РАН. Серия физическая , том 78, №9. 2014. с. 1-71-1076.

4. Булярский С.В., Зенова Е.В., Лакалин А.В., Молоденский М.С. Павлов А.А., Тагаченков А.М. Терентьев А.В. Влияние буферного слоя на формирование катализатора на основе тонкой пленки никеля для синтеза углеродных нанотрубок // Журнал технической физики, Том 88, вып. 12. 2018. с. 1873-1879.

5. Дудин А.А., Орлов А.П., Зенова Е.В., Тагаченков А.М. Методика подготовки одиночных нанотрубок для исследования их электрических характеристик // Нано- и микросистемная техника, №9. 2018. c. 515 – 520.